

# MANUAL PROXIMITY EXPOSURE SYSTEM

# MA-1200A



## 特徴 Features

- ・他品種・小ロット生産や実験・研究に最適な手動露光装置。(有効露光範囲φ6 inch)  
*Manual exposure system suitable for production with other substrate materials and in small lot, and experiment and research (effective exposure area: φ6 inch).*
- ・フットプリントを縮小することで省スペースを実現。座っての作業も可能。  
*Minimal footprint saved operation space. Operable in seated posture.*
- ・独自のミラー・レンズ光学系と高速画像処理を搭載。単眼アライメントも可能。  
裏面アライメント機能搭載可能  
*Employed original mirror/lens optical systems and high-speed image processor.  
Alignment operation with monocular and rear-plane alignment are optionally available.*
- ・4つの露光モードに対応。(フ°ロキシミティ, バ°キュームコンタクト, ハード°コンタクト, ソフトコンタクト)  
*Four exposure modes. (proximity, vacuum-contact, hard-contact, and soft-contact)*
- ・カット基板の露光が可能。  
*Exposure with cut-up substrates.*



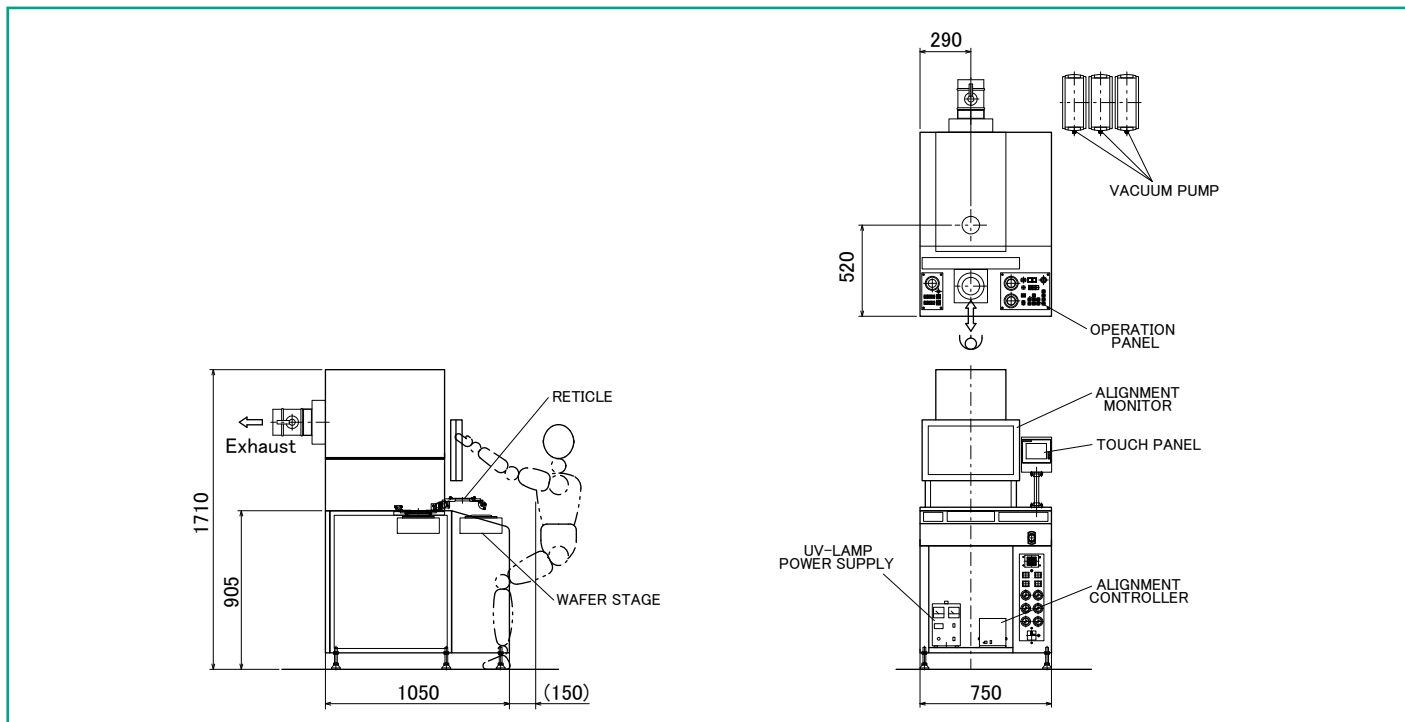
# MANUAL PROXIMITY EXPOSURE SYSTEM

## MA-1200A

### 仕様 Specifications

基板サイズ	Substrate Size	Material: Glass, Si, and other materials φ2", φ3", φ4" and max. φ6" カット基板にも対応 Applicable to cut-up substrates.
マスクサイズ	Mask Size	φ5" and max. φ7" その他のサイズについては別途ご相談ください。 Application to other mask sizes is negotiable.
アライメント	Alignment	<b>MANUAL ALIGNMENT</b> パルスまたはジョグスイッチにてアライメントステージを手動で操作しマスク側のアライメントマークに基板側のアライメントマークを合わせる Alignment stage is manually moved with three pulsers or jog switches to align alignment marks on substrate with alignment marks on mask. <b>AUTO ALIGNMENT</b> 基板側のアライメントマークを検出し、アライメントステージの駆動により、自動的にマスク側の基板アライメントマークに合わせる Alignment marks on substrates are detected to automatically align them with substrate alignment marks on mask by driving alignment stage.
ギャップ	Gap	1 to 200 μm (Servo motor) 設定分解能: 1 μm / Setup resolution: 1 μm
解像力	Resolving Power	L & S: 4 μm (ポジレジスト膜厚 1 μm, ソフトコンタクト) (Positive-resist thickness 1 μm, soft contact)
光源	Light Source	Super high-pressure UV-lamp: 500 W
寸法・重量	Dimensions & Weight	Main body: W 750 x D 1050 x H 1710 mm Main body: 400 kg

### 装置構成 Machine composition



- ※ 製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
- ※ The specifications and machine design are subject to change without notice.



株式会社大日本科研 (DNK)  
Japan Science Engineering Co., Ltd.

〒617-0002 京都府向日市寺戸町久々相1番地  
1Kuguso, Teradocho, Mukou-city, Kyoto-Pref.  
TEL : (075) 922-1146 FAX : (075) 931-9058  
URL : <http://www.kakenjse.co.jp/>